

Методики выполнения измерений ЦКП «Физика и технологии наноструктур»

1. Методика измерения топографии поверхности электропроводящих и диэлектрических материалов с атомным разрешением с использованием сканирующего туннельного микроскопа и атомно-силового микроскопа Интегра-Аура фирмы NT-MDT.
2. Методика измерения спектров поглощения и пропускания в области волновых чисел в ближней ультрафиолетовой и видимой области спектра с применением UV-VIS спектрофотометра Evolution-300.
3. Методика определения молекулярного состава жидкостей и применением жидкостного хроматографа.
4. Методика измерения элементного состава поверхности на основе возбуждения фотоэлектронов с внутренних уровней атомов рентгеновским излучением.
5. Исследование кристаллической составляющей и фазового состава материалов методом рентгеновской дифрактометрии.
6. Методика измерения частот колебаний молекул в твердых образцах с применением ИК-Фурье микроскопа.
7. Методика проведения пробоподготовки твердых образцов для элементного анализа методами атомно-эмиссионной спектрометрии с использованием микроволновой системы кислотного разложения.
8. Исследование химического состава жидких проб методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой.
9. Методика определения кристаллического состава материалов методом комбинационного рассеяния.